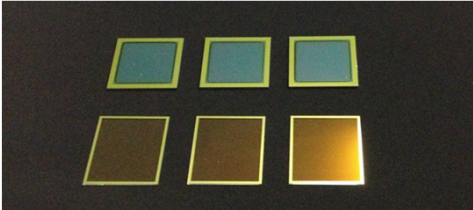


**LEDパッケージ用部品、光学式検査装置用部品などの高性能な光学薄膜製品、  
分析装置用部品などの機能性薄膜、サブマウントなどの薄膜メタライズの作製においてお客様のご要望にお応えします。**

薄膜技術	装置	各種薄膜	特徴	実施例
光学薄膜	真空蒸着	反射防止膜 (AR) 反射膜 (ミラー) 赤外線カットフィルター 偏光ビームスプリッター (PBS) 吸収膜 等 各種	高緻密誘電体膜 誘電体膜と金属膜の複合	 <p>光学設計シミュレーション</p>  <p>光学薄膜+メタライズパターニング</p>
機能膜	真空蒸着	撥水膜 親水膜	任意の接触角コントロール	 <p>60deg. 90deg. 120deg.</p> <p>接触角測定</p>
	真空蒸着/CVD	絶縁膜	高耐圧	
薄膜メタライズ	真空蒸着 スパッタリング	導電膜 Ti, Cr, Ni, Pt, Au 等	ライン/スペース 最小5 $\mu\text{m}$ / 5 $\mu\text{m}$	
		はんだ膜 AuSn	300°C以下で瞬時に熔融 膜厚 最大5 $\mu\text{m}$ 組成 $\pm 3\text{wt}\%$ (1%単位で任意)	
		抵抗膜 TaNx	TCR 100ppm/°C以下 抵抗値 $\pm 10\%$ (最小 $\pm 1\Omega$ )	